



# FST 2000

## FILM STRESS TESTER

### 薄膜应力测量仪

Based on classic Stoney formula principle, advanced laser matrix mapping technology and smart operation make the FST2000 film stress tester particularly suitable for measurement in fast characterization of wafer film residual stress.

基于经典基片弯曲法Stoney公式测量原理，采用先进的矩阵激光点阵扫描方式和探测技术，以及智能化的操作，使得FST2000薄膜应力仪特别适合于晶圆类光电薄膜样品的曲率半径和应力测量。

独特的双模扫描模式方便适应不同应用场景下需求：Mapping不同区域的薄膜应力分布或快速表征样品整体平均残余应力。



Dual mode Scanning!

双模扫描!

Automatic Measurement!

全自动测量!

High Cost-effective !

高性价比!

SuPro Instruments LTD

速普仪器

Nanshan ,

Shenzhen, China

[Http://www.suproinst.com](http://www.suproinst.com)

Tel: 86-755-26642901

Fax: 86-755-26419205

Email: [sales@suproinst.com](mailto:sales@suproinst.com)

技术规格	参数
基本原理	激光曲率法 / 基于Stoney公式
主要方法	采用5×5 激光点阵对样品进行扫描测量 635 nm波长/ 5mW
主要功能	自动测量计算曲率半径和薄膜应力
扫描模式	Mapping面扫模式（主要表征局部区域的薄膜曲率半径或应力分布） L-D线扫模式（快速表征样品整体薄膜平均曲率半径或残余应力）
薄膜应力测试范围	5 MPa~5 GPa
曲率半径测试范围	2-200 m
曲率半径重复精度	<1 %（曲率半径< 20 m）， <3 %（曲率半径 < 100 m）
扫描最小步长	0.1 mm
扫描最多点数	>1 万点
样品最大尺寸	M100型号：4 英寸 M200型号：8 英寸
样品最小尺寸	> 15*15 mm 样品
样品基片校正	可数据处理校正原始表面不平影响（对减模式）
电源	110-220 VAC & 200 Watts Maximum
通讯连接端口	USB 3.0
工作温度	0~50 °C
操作软件	可视化2D/3D显示 视窗界面/适用于Windows 7/Windows 10系统
操作电脑	标配台式一体机：显示器>21英寸，8G内存，Intel CPU，256G硬盘
外形尺寸	M100型号：~950×400×480 mm M200型号：~1050×500×480 mm
重量	~40K g
质量保证	一年免费/终身维护
备注	以上所列技术规格与参数更新恕不另行通知，如有疑问请联系我们



深圳市速普仪器有限公司

地址：深圳市南山区桂庙路22号向南瑞峰B2009

电话：0755-26642901 传真：0755-26419205

邮件：sales@suproinst.com

Http://www.suproinst.com

淘宝店：速普仪器

深圳市速普仪器有限公司（北京办事处）

地址：北京市丰台区丰台镇北大街北里甲1号8幢302

电话：010-63839091 传真：010-63839091

邮件：zkchang@suproinst.com